

ISSN 0544-1269 (Print)
ISSN 3034-5480 (Online)



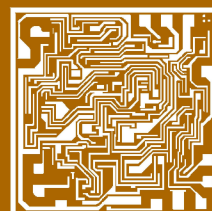
Российская Академия Наук

2025, том 54, номер 5

Сентябрь–Октябрь



МИКРОЭЛЕКТРОНИКА RUSSIAN MICROELECTRONICS



НАУКА

— 1727 —

СОДЕРЖАНИЕ

2025, том 54, номер 5

ДИАГНОСТИКА

Метод тестирования радиационной стойкости материалов полупроводниковой электроники в электронном микроскопе

В. А. Киселевский, А. А. Татаринцев 347

Комплементарные исследования тонких пленок алюминия: удельное сопротивление и реальная структура

А. А. Ломов, М. А. Тарасов, К. Д. Щербачев, А. А. Татаринцев, А. М. Чекушкин 357

КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Прецизионная реконструкция поляризационных квантовых состояний в условиях запущенных измерений

И. К. Голышев, Н. А. Богданова, Ю. И. Богданов, В. Ф. Лукичев 371

МОДЕЛИРОВАНИЕ

О корректности модельного описания состава плазмы в смеси $\text{SF}_6 + \text{He} + \text{O}_2$

А. В. Мяконьких, В. О. Кузьменко, А. М. Ефремов, К. В. Руденко 381

ПРИБОРЫ

Структура и материалы FinFET транзисторов

Д. А. Абдуллаев, Л. М. Колчина, Р. А. Милованов 393

ТЕХНОЛОГИИ

Обработка пластин карбида кремния связанным алмазным инструментом

*В. С. Кондратенко, А. А. Исаев, В. В. Кадомкин, Г. М. Бирюков,
И. И. Бородинкин, А. Д. Тамбовский* 429

О влиянии различных кислородсодержащих газов на состав плазмы трифторметана

А. М. Ефремов, Е. Е. Корякова, В. Б. Бетелин, К.-Н. Кwon 438

Деформирование мембраны МЭМС-преобразователя с нанесенным напряженным слоем

В. В. Амеличев, С. С. Генералов, И. В. Годовицын, С. А. Поломошнов, М. А. Сауров 447

CONTENTS

2025, volume 54, no. 5

DIAGNOSTICS

Method for testing the radiation resistance of semiconductor electronic materials in an electron microscope

V. A. Kiselevskiy, A. A. Tatarintsev 347

Complementary studies of aluminum thin films: resistivity and real structure

A. A. Lomov, A. M. Tarasov, K. D. Shcherbachev, A. A. Tatarintsev, A. M. Chekushkin 357

QUANTUM TECHNOLOGIES

Precise reconstruction of polarization quantum states under noisy measurement conditions

I. K. Golyshev, N. A. Bogdanova, Yu. I. Bogdanov, V. F. Lukichev 371

MODELING

On the correctness of the model description of the plasma composition in the mixture of $\text{SF}_6 + \text{He} + \text{O}_2$

A. V. Myakontkikh, V. O. Kuzmenko, A. M. Efremov, K. V. Rudenko 381

DEVICES

Structure and materials of FinFET transistors

D. A. Abdullaev, L. M. Kolchina, R. A. Milovanov 393

TECHNOLOGIES

Processing of silicon carbide plates with bonded diamond tools

*V. S. Kondratenko, A. A. Isaev, V. V. Kadomkin, G. M. Biryukov,
I. I. Borodynkin, A. D. Tambovsky* 429

On the influence of various oxygen-containing gases on composition of trifluoromethane plasma

A. M. Efremov, E. E. Koryakova, V. B. Betelin, K.-H. Kwon 438

Deformation of MEMS transducer membrane due to stress in deposited film

V. V. Amelichev, S. S. Generalov, I. V. Godovitsyn, S. A. Polomoshnov, M. A. Saurov 447
